

NIMS微細加工共用設備 利用料金表（内部利用）

（税抜表示）

No.	装置リスト	NIMS利用者（NIMS所属かつNIMS予算での支出に限る）		
		機器利用	技術補助	技術代行
1	電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	¥10,000	¥13,000	¥16,000
2	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥6,000	¥9,000	¥12,000
3	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥4,000	¥7,000	¥10,000
4	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
5	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥4,000	¥7,000	¥10,000
6	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥4,000	¥7,000	¥10,000
7	マスクアライナー [MA-6]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
8	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
9	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
10	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
11	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
12	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #1]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
13	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
14	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
15	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
16	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
17	電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
18	電子銃型蒸着装置 [UEP-3000BS]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
19	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
20	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
21	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
22	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
23	リフトオフ装置 [KLO-150CBU]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
24	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
25	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
26	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥4,000	¥7,000	¥10,000
27	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
28	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
29	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
30	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
31	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
32	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
33	FE-SEM [S-4800]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
34	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥4,000	¥7,000	¥10,000
35	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥4,000	¥7,000	¥10,000
36	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥4,000	¥7,000	¥10,000
37	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
38	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
39	走査型プローブ顕微鏡 [L-trace]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
40	走査型プローブ顕微鏡 [Nanoscope5]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
41	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
42	レーザー顕微鏡 [VK-9700]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
43	イオンスパッタ [E-1045]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
44	触針式プロファイラー [Dektak XT-A]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
45	触針式プロファイラー [Dektak 6M]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
46	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
47	分光エリブソメーター [M2000]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
48	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
49	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
50	ダイシングソー [DAD322]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
51	ダイシングソー [DAD3220]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
52	室温ブローバー [MX-200/B]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
53	室温ブローバー [HMP-400]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
54	低温ブローバー [GRAIL-408-32-B]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
55	液体窒素ブローバー [SB-LN2]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
56	ワイヤーボンダー [7476D #1]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
57	ワイヤーボンダー [7476D #2]	¥2,000	¥5,000	¥8,000
58	ウェットステーション	¥2,000	¥5,000	¥8,000
59	CAD作成システム	¥2,000	¥5,000	¥8,000
60	クリーンルーム	¥2,000	¥5,000	¥8,000

【備考】

- 1, 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価（税抜）であり、これに利用時間（※）を乗じます。
 - 2, 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
 - 3, 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
 - 4, 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
 - 5, 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
 - 6, 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。
- ※ 利用時間は、装置予約時間（=装置占有時間：装置の立ち上げ/終了作業時間含む）です。